

논문88 - 3 - 4

(Se,S)를 기본으로 한 비정질 박막의 Relief-형 각자 형성과 회절 효율에 관한 연구

A Study on the Relief-type Grating Formation and Diffraction Efficiency of Amorphous (Se,S)-based Thin Films

최 대 영*
박 태 성
정 풍 배
김 종 린

광운대학교 전자재료공학과
조선대학교 전자공학과

Dae-Young Choi
Tae-Sung Park
Hong-Bay Chung
Jong-Bin Kim

Kwangwoon Univ.
Electronic Mat. Eng. Dep.
Chosun Univ.
Electronic Eng. Dep.

ABSTRACT

This paper is investigated on the diffraction grating formation of the amorphous As-Se-S-Ge films. As₄₀ Se₁₈ S₃₅ Ge₁₀ film of thickness 0.76 μm has achieved a high diffraction efficiency of 4.6%. In this film, high diffraction efficiency is increased to 18% by chemical etching.

1. 서론

(Se,S)를 기본으로 한 비정질 칼코게나이드 박막은 구조적으로 커다란 결함밀도 (defect density)와 고립전자쌍의 존재, 그리고 낮은 평균배위수 (<2.45) 등과 같은 특성으로 인하여 구조적인 유연성이 있으며 광노출과 열처리에 의해 광학 에너지 갈의 이동, 굳질을 변화, 박막두께 변화, 화학적 활성도 변화등과 같은

광학적 매질로서의 응용 가능성이 현재까지 연구되어 왔다. 또한 비정질 칼코게나이드 박막은 광노출된 영역과 노출되지 않은 영역 사이에 알카리 용액내에서 현상속도 차이가 있으므로, 이와 같은 현상속도 차이는 박막 내의 두께차를 형상하여 보다 큰 굽침을 차이를 일으키는 것으로 보고되고 있다.^[2,3]

따라서 본 실험에서는 (Se,S)를 기본으로 한 물질 중 구조적으로 광학적 특성이 안정된 As₄₀ Se₆₀-S_x Ge₁₀ 계를 선택하여 Se과 S의 첨가량 ($x=0, 25, 35$ at.%)에 박막 두께를 변화시켜 박막 내에 각자를 형성시킴과 동시에 회절효율을 관찰한다. 그리고 선택적 현상속도 차이를 이용한 Relief-형 각자의 회절효율을 비교 연구 하므로서 흐로그램 매질로서의 최적 조건을 조사하며, 이를 박막에 서 grating 형성을 통하여 광전집적회(OLEIC)를 이루기 위한 기능 소자로서의 다양한 응용성을 타진해보고자 한다.^[4,5]

2. 실험

1) 시료제조

비정질 칼코게나이드 $\text{As}_{40}\text{Se}_{50-x}\text{S}_x\text{Ge}_{10}$ 계에서 $x=0, 25, 35$ at.%의 조성을 선별하여 전기로에서 850°C 로 25시간 동안 가열한 후 실온에서 굽냉하였다.

2) 박막제작

본 실험에서 사용한 박막은 전자 빔 증착기 (electron-beam evaporator)를 사용하여, 진공도 6×10^{-6} Torr, 그리고 증착속도를 5Å/sec 으로 각각 $0.65, 0.76, 1.1, 1.65\text{ }\mu\text{m}$ 의 박막 두께로 제작하였다.

3) Grating 형성 및 회절효율 측정

본 실험에서 형성한 grating은 two-beam interference 방법을 이용하여 Ar^+ 레이저로 형성되었으며, 회절효율을 측정하기 위하여 김출 광원으로 He-Ne 레이저를 사용하였다. Grating 형성과 회절효율 측정에 이용한 광학 system은 그림1과 같다. 또한 0.33N의 NaOH 용액에서의 회절효율 측정도 같은 방법으로 실행하였으며, 그림2에 실험 장치 개요도를 나타내었다.

3. 결과 및 고찰

노출세기를 각각 $10\text{mW/cm}^2, 40\text{mW/cm}^2$ 으로 했을 경우 박막두께에 따른 회절효율을 그림 3,4에 나타내었다. 노출세기 40mW/cm^2 에서 더욱 좋은 회절효율이 관찰되었으며, $\text{As}_{40}\text{Se}_{15}\text{S}_{35}\text{Ge}_{10}$ 박막에서 4.6%의 최대 회절효율을 나타내었다. 그림5에서는 노출세기를 40mW/cm^2 으로 한 $0.76\mu\text{m}$ 박막의 예장시간에 따른

회절효율을 나타내었다. 회절효율은 예장시간이 길어질수록 증가하였으며, 예장시간을 2분으로 하였을 경우 18%의 최대 회절효율을 나타내었다. 사진1에서는 두께 $0.76\text{ }\mu\text{m}$ $\text{As}_{40}\text{Se}_{15}\text{S}_{35}\text{Ge}_{10}$ 박막에 형성한 relief-형 회절각자를 나타내었다.

4. 결론

이상의 실험 결과로부터 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

1) $\text{As}_{40}\text{Se}_{50-x}\text{S}_x\text{Ge}_{10}$ 계에서 grating이 형성된 박막의 회절효율은 박막의 조성비, 두께, 노출세기 등에 의존하며, S의 함유량이 커질수록 회절효율이 증가하였다.

2) $\text{As}_{40}\text{Se}_{15}\text{S}_{35}\text{Ge}_{10}$ 박막 중 두께가 $0.76\mu\text{m}$ 인 박막에 노출세기를 40 mW/cm^2 으로 하였을 경우 4.6%의 최대 회절효율을 나타내었다.

3) 위의 박막을 일칼리 용액내에서 예장하였을 경우 18%의 최대 회절효율을 얻었다.

이상의 결과로부터 본 실험에서 사용한 As-Se-S-Ge계 박막은 훌륭한 광용매진보서의 최적 조건과 Relief-type diffraction grating 형성을 통해 보다 형상된 회절효율을 얻을 수 있으므로, 광전집적화를 이루기 위한 기능소자로서의 가능성이 기대된다.

5. 참고문헌

1. Y. Ohmachi & T. Igo, Appl. Phys. Lett., vol.20, 506, 1972.
2. S. Zembtsu, Applied Optics, vol.14, 3073 1975.
3. K. Tada, N. Tanino, T. Murai, M. Aoki,

Thin Solid Films, vol.96, 141, 1975.

4. K. Tanaka, J. Non-Cryst Solids, vol.59/60, 925, 1983.
5. K. Tanaka, Appl. Phys. Lett., vol.26, 243, 1975.
6. A. Singh, L. Song, Applied optics, vol. 36, 2474, 1987.
7. K. Tada, N. Tanino, T. murai, M. Aoki, Thin Solid Films, vol.96, 141, 1982.
8. 문 혁, 광운대학교 석사학위 논문, 1987.
9. 박태성, 정홍배, 김종빈, 전자재료학회 춘계 학술대회 논문집, 1988.

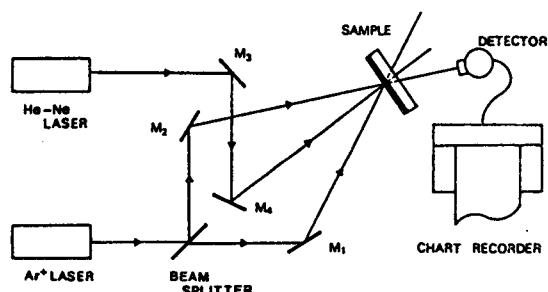


그림 1. 격자 형성과 회절효율 측정을 위한 광학장치.
Fig. 1. Optical system for the grating.

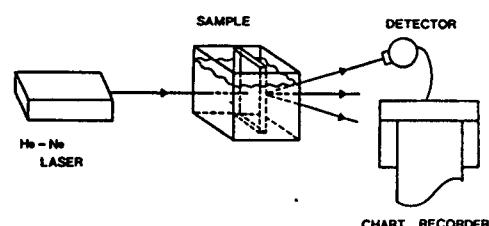


그림 2. 릴ief-형 격자의 회절효율 측정을 위한 개요도.
Fig. 2. The schematic diagram for measuring the diffraction efficiency of relief type grating.

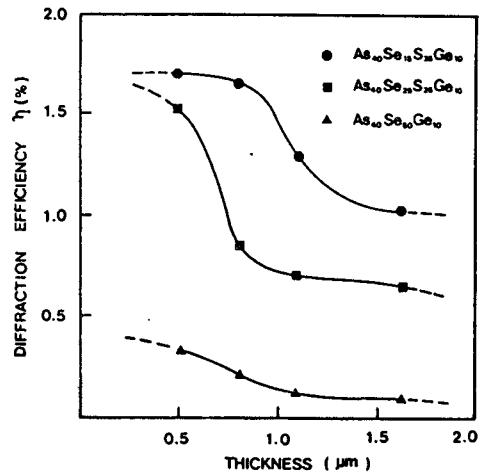


그림 3. 박막 두께에 따른 최대 회절효율.
Fig. 3. Maximum diffraction efficiency versus film thickness.(exposure power; $10\text{mW}/\text{cm}^2$)

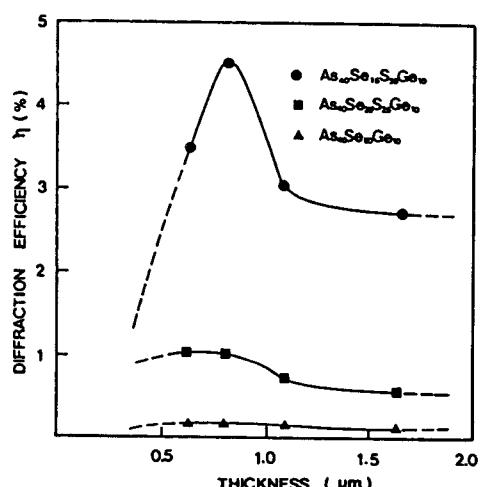


그림 4. 박막 두께에 따른 최대 회절효율.
Fig. 4. Maximum diffraction efficiency versus film thickness.(exposure power : $40\text{mW}/\text{cm}^2$)

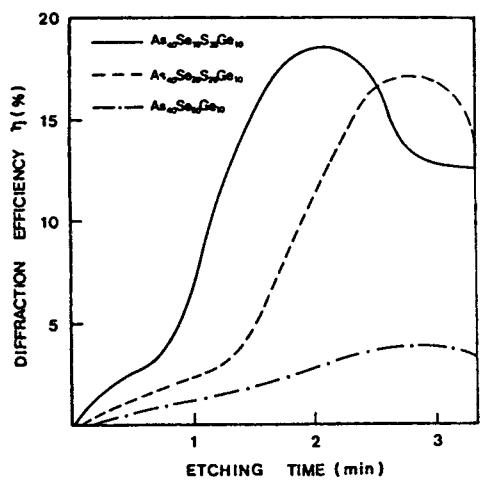


그림 5. 예정 시간에 따른 회절 효율.
 Fig. 5. Diffraction efficiency curves
 as a function of etching time.
 (thickness ; 0.76 μm , exposure
 power ; 40mW/cm²)

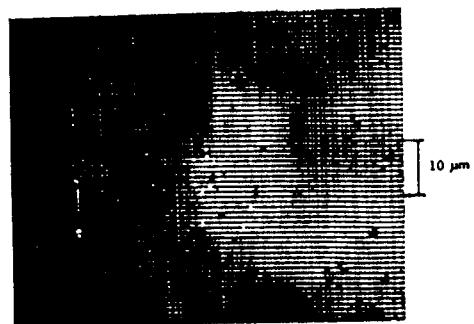


사진 1. Relief-형 회절 각자 사진.
 Photo 1. Photomicrograph of relief type
 diffraction grating in $\text{As}_{40}\text{Se}_{50}$
 S_3Ge_{10} film.(grating spacing;
 0.67 μm)